

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CAMPOBASSO



MODELLO OFFERTA TECNICA

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE (SEM) DOTATO DI UN SISTEMA DI MICROANALISI A RAGGI X EDS PER I BENI CULTURALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DELLA REGIONE MOLISE" PROGETTO DI RICERCA "VALORIZZAZIONE E RICERCA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA A SANT'ELIA A PIANISI"

CIG:8863484A60

CUP H84I19001340001

Barrare la casella di interesse

A) Risoluzione garantita a 30 kV con detector SE	<4.0 e \geq 3.5nm	MAX 6	<input type="checkbox"/>
	< 3.5nm e = 3.0 nm		<input type="checkbox"/>
	< a 3 nm		<input type="checkbox"/>
B) Risoluzione garantita a 3 kV con detector SE	< di 15 nm e > di 8 nm	MAX 4	<input type="checkbox"/>
	\leq di 8 nm		<input type="checkbox"/>
C) Tensione di accelerazione: valore minimo	<500V e \geq 300V	MAX 5	<input type="checkbox"/>
	<300V		<input type="checkbox"/>
D) Step minimo per la regolazione della tensione di accelerazione sull'intera scala	\geq 20eV	MAX 4	<input type="checkbox"/>
	<20eV e \geq 10eV		<input type="checkbox"/>
	<10 e \leq di 5eV		<input type="checkbox"/>
E) Ingrandimento minimo, senza distorsione dell'immagine	<10X e \geq 5X	MAX 4	<input type="checkbox"/>
	<5X e \geq 3X		<input type="checkbox"/>
	< 3X		<input type="checkbox"/>
F) Field of view alla distanza di lavoro analitica	= 5mm	MAX 3	<input type="checkbox"/>
	>5mm e \leq 7 mm		<input type="checkbox"/>
	>7mm		<input type="checkbox"/>

G) Modalità di selezione della corrente di probe (e relativo riallineamento del fascio) per tutto l'intervallo di correnti e kV disponibili	prevede l'uso di diaframmi/aperture multiple meccaniche	MAX 2	<input type="checkbox"/>
	esclusivamente di tipo elettromagnetico ovvero non deve prevedere nè aperture meccaniche in colonna per il centraggio, l'allineamento e la selezione delle correnti di fascio, né la presenza di apparati meccanici in colonna per il posizionamento, il cambio e il centraggio di tali aperture		<input type="checkbox"/>
H) Diametro o diagonale della camera di lavoro in cm	$D \leq 35$	MAX 3	<input type="checkbox"/>
	$D > 35$ e $D \leq 45$		<input type="checkbox"/>
	$D > 45$		<input type="checkbox"/>
I) Numero di porte nella camera di lavoro per tecniche accessorie	>10 e <14	MAX 3	<input type="checkbox"/>
	>14 e ≤ 18		<input type="checkbox"/>
	> 18		<input type="checkbox"/>
J) Escursione tavolino traslatore per gli assi X e Y	X e Y $>100\text{mm}$ e $\leq 125\text{mm}$	MAX 2	<input type="checkbox"/>
	X e Y $>$ di 125 mm		<input type="checkbox"/>
K) Escursione dell'asse Z	$>$ di 50mm e $\leq 70\text{ mm}$	MAX 3	<input type="checkbox"/>
	$> 70\text{mm}$ e $<$ di 90 mm		<input type="checkbox"/>
	$\geq 90\text{ mm}$		<input type="checkbox"/>
L) Rivelatore di elettroni retrodiffusi	stato solido a due settori	MAX 5	<input type="checkbox"/>
	stato solido a quattro o più settori		<input type="checkbox"/>
	a scintillazione con cristallo YAG a scintillazione		<input type="checkbox"/>
M) Risoluzione delle immagini digitali salvate in pixel	$> 4\text{K} \times 4\text{K}$ e $< 16\text{k} \times 16\text{k}$	MAX 4	<input type="checkbox"/>
	$\geq 16\text{K} \times 16\text{K}$ e $< 20\text{k} \times 20\text{k}$		<input type="checkbox"/>
	$>$ di $20\text{k} \times 20\text{k}$		<input type="checkbox"/>
N) Numero di segnali che possono essere acquisiti contemporaneamente	≤ 4 segnali	MAX 2	<input type="checkbox"/>
	≥ 4		<input type="checkbox"/>
O) Telecamera CCD per la visualizzazione del tavolino portacampioni	presente	MAX 3	<input type="checkbox"/>
P) Diagnostica da remoto	prevista	MAX 2	<input type="checkbox"/>

Q) Rivelatore del sistema EDX: area attiva	> di 10mm ² e < di 30mm ²	MAX 3	<input type="checkbox"/>
	≥ 30mm ²		<input type="checkbox"/>
R) Sistema EDX: possibilità di navigare sul campione col SEM con raccolta istantanea di una mappa X di distribuzione dei vari elementi	non presente	MAX 4	<input type="checkbox"/>
	presente		<input type="checkbox"/>
S) Estensione della garanzia sul Microscopio Elettronico e sistema EDX (rivelatore escluso)	ulteriori 12 mesi	MAX 3	<input type="checkbox"/>
T) Contratto di assistenza per la manutenzione annuale sul Microscopio Elettronico a scansione (SEM) e sul sistema EDX (escluso parti di ricambio) con una visita di manutenzione ordinaria ad anno e verifica della funzionalità complessiva della strumentazione	> 10000 euro	MAX 5	<input type="checkbox"/>
	> 6000 < 10000 euro		<input type="checkbox"/>
	> 4000 < 6000 euro		<input type="checkbox"/>
	≤ 4000 euro		<input type="checkbox"/>

Luogo e Data , _____

(timbro e firma per esteso del legale rappresentante)